MPI TS3500-SE | 300 mm ShielDEnvironment™ 付きフルオート・プローブシステム

超低雑音IV、CV、パルスドIV、1/f およびRF 測定向け。オプションで WaferWallet® 追加–フルオート測定用

最大4台の8Uサイズの計測器設置可能な計測器棚オプション

- システム背後に計測器用棚を設置し、RFケーブルを短くして測定性能と指向性を向上
- その上に2階構造を追加
- WaferWallet® 上部には、DCパラメータアナライザやスイッチマトリクス、オシロスコープなどを設置できる二段式棚を用意

顕微鏡ブリッジおよび顕微鏡

- 安定した顕微鏡ブリッジマウントにより、計測機器へのアクセスが容易
- 50 × 50 × 140 mm の可動範囲をプログラム制御可能
- MPIIMAG®シリーズ—高速オートフォーカスを備えたデジタル顕微鏡

マイクロポジショナおよび プローブカード

- 最大4本のRFおよび8本のDC手動／プログラマブル・マイクロポジショナに対応
- mmWアプリケーション向けの大型やプログラマブル型など、幅広いマイクロポジショナを選択可能
- 専用の同軸、トライアキシャル、ケルビンのプローブアームを用意
- 4.5インチ・プローブカードホルダ：標準タイプまたは長時間測定用の専用タイプを選択可能

プローブ・プラテン

- 安定で堅牢な設計
- RFポジショナ用の角型調整機構
- 最大限の熱安定性を実現するためのエア冷却機構を内蔵

ShielDEnvironment™

- 先進のEMI/RFI/光遮蔽設計により、最高レベルの1/fノイズ測定を実現
- fAレベルの低リーク性能

MPI WaferWallet® オプション

- 150、200、300 mm ウエハに対応
- 任意の温度でホット／コールドのウエハ交換可能
- 計測機1台用の統合棚を装備
- オプション：自動プリアライナーおよびウエハIDリーダー
- 現場でのアップグレードに対応

オプション

- VCE™（Vertical Control Environment™） — SENTIO® による自動接触検出用のサイドビューカメラを提供
- WaferWallet® ファミリー — FOUP/FOSBカセット対応、FOUPカセット用ロードポートおよびOHTシステム経由での搬送に対応
- Ice Free Cap — 低温環境下での測定に対応

SENTIO® (Windows 11)ソフトウエア

- 直感的で簡単に操作できる革新的なマルチタッチ対応のシングルウィンドウGUI
- MPIのRF校正ソフトウエア QAlibria® と統合されたワークフローにより、比類ないユーザーインターフェースを提供
- 数百種類のリモートコマンドに対応

RF 校正ソフトウエアQAlibria®

- RF校正用基板用のセラミック製補助チャック2基
- 2ポートまたは4ポートRF測定に対応。プローブ位置はN/S/E/W または N/S、E/W の構成が可能

ジョイスティック搭載 一体型ハードウエア操作パネル

- より高速で、安全かつ便利なシステム操作と制御
- キーボードとマウスをシステム操作パネルに配置し、システムおよび計測機を一元操作可能

AirCool® PRIME 温度チャック

- QuickConnect™ — 複数のシステム間でチラーを共有可能
- MPIとERSによる共同設計で、より高速な切り替えとソーク時間の短縮を実現
- -60°C～300°Cの温度範囲に対応する各種チャックを用意 — 現地アップグレード可能
- コントロールパネルを使いやすい位置に配置し、システムとの迅速かつ容易な操作を実現
- チャックエアの再循環によるパージ用途で大幅なコスト削減

一体型防振テーブル

- チラー用スペースをスマートに統合することで設置面積を削減

mDrive™ オプション

- チャック、顕微鏡、マイクロポジショナなど、既存のプログラム可能な全ステージを直感的に手動操作可能
- 選択したステージのX軸、Y軸微調整機能
- Z軸の安全機能を使用するには、追加の有効化操作が必要